

[Afficher tous les 2 produits de la même famille.](#)

Miroir Plan EUV, 3,5 nm, 25,4 mm de dia., AOI 5°



Extreme Ultraviolet (EUV) Flat Mirrors

Stock **#38-759** **9 In Stock**

-

1

+

€2.750⁰⁰

AJOUTER AU PANIER

Prix sur Quantité	
Qté 1+	€2.750,00 prix unitaire
Need More?	Demande de Devis

i Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement

Caractéristiques du produit

	Type:
Flat Mirror	

Propriétés physiques et mécaniques

25.40 ±0.25	Diamètre (mm):
6.35 ±0.508	Épaisseur (mm):
	Surface Arrière:

Commercial Polish	
90	Ouverture Utile (%):
Fine Ground	Bords:
3	Parallélisme (arcmin):

<5 RMS	Rugosité de Surface (Angstroms):
--------	----------------------------------

Propriétés optiques

Metal/Semiconductor	Type de Traitement:
Mo/Si Multilayer Top Layer: Silicon	Traitement:

λ 10 @632.8nm	Planéité de Surface (P-V):
13.18 - 13.68	Gamme de Longueur d'Onde (nm):

13.5	Longueur d'Onde de Conception DWL (nm):
Single Crystal Silicon	Substrat: □

5	Angle d'Incidence (°):
R _{abs} >60% @ 13.5nm, 5° (s-pol)	Spécification du Traitement:

10-5	Qualité de Surface:
>60	Réflexion à la Longueur d'Onde de Conception (%):

0.50	Largeur à Mi-Hauteur FWHM (nm):
------	---------------------------------

Electrical

92	Énergie Centrale (eV):
----	------------------------

Conformité réglementaire

Visionner	Certificate of Conformance:
---------------------------	-----------------------------

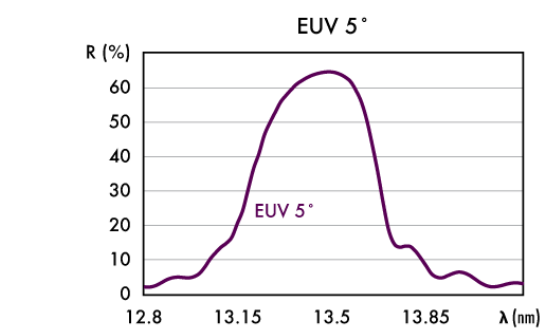
Description produit

- Réflexion maximale atteignable à 13,5 nm
- Conçus pour diriger le faisceau UVE et séparer les harmoniques
- Disponibles en versions angle d'incidence (AOI) de 5° et 45°

Les Miroirs Plans Ultraviolets Extrêmes (UVE) TECHSPEC® sont des miroirs multicouches conçus pour apporter la réflectivité maximale pouvant être atteinte à la longueur d'onde et l'angle d'incidence de conception. Ces miroirs présentent un traitement déposé sur un substrat de silicium monocristallin superpoli et une rugosité de surface inférieure à 3 $\square$ RMS. Les miroirs à AOI de 45° se révèlent utiles pour diriger les faisceaux polarisés S tandis que les miroirs à AOI de 5° peuvent être utilisés avec des faisceaux non polarisés. Les applications portant sur les miroirs UVE comprennent l'Imagerie par Diffraction Cohérente (Coherent Diffractive Imaging, CDI) et la recherche en science des matériaux. Les Mroirs Plans Ultraviolets Extrêmes (UVE) TECHSPEC peuvent également servir de sélecteurs harmoniques pour les faisceaux à Génération d'Harmoniques d'Ordre Élevé (High Harmonic Generation, HHG).

Remarque: Les données de test d'un échantillon sont incluses pour chaque cycle de production de miroirs.

Informations techniques



Montures compatibles

;